

## Dispositivo para Trabajo bajo Campo Eléctrico Intenso Emplazable en Espectrómetros Mecánicos

### Descripción de la tecnología

La presente invención se refiere al diseño e implementación de un dispositivo para la realización de ensayos de espectroscopía mecánica (también conocidos en inglés como "dynamic mechanical analysis", o DMA), bajo la aplicación de un campo eléctrico intenso (superior a 100 kV/m). La presente invención puede ser emplazada en cualquier tipo de espectrómetro mecánico operando en oscilaciones torsionales o longitudinales. Los materiales a ser estudiados incluyen todo tipo de materiales poliméricos/dieléctricos sólidos. El dispositivo permite además realizar mediciones en función de la temperatura.

### Aplicaciones

La presente invención puede ser utilizada en espectrómetros mecánicos operando tanto en unidades científico-académicas como en industrias. Este dispositivo puede ser utilizado para estudiar todo material dieléctrico que pueda ser susceptible de un ensayo de espectroscopía mecánica.

### Ventajas

Esta invención presenta la novedad de permitir la realización de ensayos de espectroscopía mecánica bajo la acción de un campo eléctrico intenso.

### Estado de desarrollo

Existe un prototipo en funcionamiento de esta invención.

### Estado de la patente

Fecha de prioridad: 10/2/2013. Número de prioridad: AR2013P103580. En trámite en: Argentina.

### Inventor referente

Dr. Osvaldo A.F. Lambri

0152-1

Palabras claves : Industria | Estudio de Materiales | espectroscopía mecánica | campo eléctrico